

EV GROUP Expands Collaboration with ITRI on Heterogeneous Integration Process Development – August 31, 2022





台北,2022年8月31日— 微機電系統(MEMS)、 奈米科技與半導體市場的晶團接合暨微 影技術設備之領導廠商EV Group(EVG),今日宣布攜手工業技術研究院(以下簡稱工研 院) 擴大先進異質整合製程的開發。

在半導體製造中,随著超越電晶體微縮的更高效能需求提升,3D重直堆疊與將多種不同的 组件與晶粒,從製造、組裝到封裝至單一設備或封裝中的異質整合封裝技術,也促成了高頻寬 互連,以提升整體系統的效能,更成為AI人工智慧、自動駕駛與其它高效能運算應用的關鍵驅 動力,經濟部多年前就看到此前瞻技術的發展潛力,積極推動「人工智慧晶片異質整合模組前 瞻製造平台」及「可程式化異質3D整合」等國家級的研發專案;並支持工研院成立異質整合小 晶片系統封裝聯盟(Heterogeneous Integration Chip-let System Package Alliance; Hi-CHIP),協助打造包括封裝設計、測試與驗證,及試產生產的完整生態系,已逐步達成供應 鏈在地化的目標,更成功擴展商機。由於EVG是Hi-CHIP聯盟成員之一,多套EVG最先進的晶 圓接合與微影系統,包括LITHOSCALE®無光罩曝光微影系統、EVG®850 DB自動化剥離系統 及GEMINI®FB混合接合系統將於2022年底前進駐工研院3D-IC實驗室;未來將工研院的先進 設備導入量產平台後,將協助雙方的共同客戶加速開發全新異質整合製程,拓展至客戶端的晶 圓廠。

工研院電子與光電系統研究所副所長駱韋仲表示,工研院的使命為帶動工業發展、創造經 濟價值並透過科技的研發增進社會福祉,長期以來持續開發全新3D與異質晶片整合製程,並為 供應鏈打造更緊密的合作關係,推進半導體產業持續發展與成長。由於工研院的全自動化量產 系統與合作業者的晶圓廠規格相同,包括來自EVG的全新晶圓接合與微影解決方案,有利於業 者立即將工研院開發的製程配方導入生產過程,加速從實驗室到晶圓廠量產上市時程。 EV Group執行董事會成員暨銷售與客戶支援執行總監Hermann Waltl表示,EVG自1980年 在奧地利成立以來,秉持發明(invent)、創新(innovate)、實作(implement)「3I」理 念,積極與工研院等全球領先的研究機構合作,加速推動半導體產業未來創新的新技術開發與 商業化。EVG目前在全臺皆有優秀的製程與應用工程團隊,過去幾年來已大幅擴展製程相關基 礎架構,未來雙方在持續合作下,除了讓EVG取得世界級的研究專業知識,更能進一步強化 EVG在臺灣的製程優勢,滿足在臺客戶與合作業者逐步增加的需求與挑戰。

關於工業技術研究院

工業技術研究院是國際級的應用研究機構,擁有六千位研發尖兵,以科技研發,帶動產業 發展,創造經濟價值,增進社會福祉為任務。自1973年成立以來,率先投入積體電路的研發, 並孕育新興科技產業;累積超過三萬件專利,並新創及育成包括台積電、聯電、台灣光罩、晶 元光電、盟立自動化、台生材等上市櫃公司,帶動一波波產業發展。面對人口往都市集中以及 高能化的趨向,當科技改變生產及將費模式,氣候變遷帶來2050淨零破排全新的機會與挑戰, 環境與維源改變的催促迫在眉睫,後疫情時代下丕變的國際局勢,工研院聚焦客戶新價值,找 出新需求,擘畫「2030技術策略與藍圖」為解決方案,厚植AI、半導體晶片、通訊、資安與雲 端、智慧感測等五大智慧化致能技術,聚焦「智慧生活」、「健康樂活」、「永續環境」三大 應用領域的研發方向,用科技創新翻轉生活,以市場需求為導向、發展解決方案、創建嶄新市 場,以謀求人類社會福祉,引領產業社會邁向美好未來。

關於EV Group (EVG)

EVG是全球半導體、微機電、化合物半導體、電源元件和奈米科技應用的晶團製程解決方 案領導廠商,主要產品包括晶團鍵合、晶團薄化、微影/奈米壓印微影技術(NIL)和檢測設 備,以及光阻塗佈機、顯影機、晶圓清洗和檢測設備。EVG成立於1980年,藉由一個完備的 全球網絡資源為全球的客戶和合作夥伴提供服務。更多相關資訊請參考公司網站: www.EVGroup.com。

https://m.match.net.tw/pc/news/finance/20220831/6750776